

2021 年日本表面真空学会学術講演会講演募集

日本表面真空学会では「2021 年日本表面真空学会学術講演会」を 2021 年 11 月 3 日（水）～5 日（金）、オンラインで開催いたします。学術講演会では、分野別セッションと部会セッションが予定されています。昨年に引き続き二度目のオンライン開催となりますが、充実した講演会になりますよう、多数の方々のご投稿・ご参加をお待ちしております。

詳細は、順次日本表面真空学会ホームページに掲載しますので、ご確認ください：<https://www.jvss.jp/>

1. 期 日：2021 年 11 月 3 日（水）、4 日（木）、5 日（金）

2. 開催形式：オンライン開催

3. 講演プログラム内容

3.1 一般講演

3.2 部会セッション

放射光表面科学部会

摩擦の科学研究部会

表面分析研究部会

プローブ顕微鏡研究部会

データ駆動表面科学研究部会

マイクロビームアナリシス技術部会(MBA)

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会(SP 部会)

などを予定

3.3 その他

詳細は、次号以降の会誌の会告ならびにウェブページ
で随時お知らせいたします。

4. 一般講演の募集要項

4.1 講演情報

口頭発表とポスター発表。

口頭発表は、Zoom によるオンライン講演、講演時間 1 件 15 分(討論時間 5 分を含む)。

ポスター発表もオンラインとなります。詳細は、次号以降の会誌の会告ならびにウェブページ
で随時お知らせいたします。

4.2 登壇者資格

登壇者は日本表面真空学会の個人正会員、学生会員、および法人正会員・維持会員・賛助会員の所属社員に限り、これらに該当しない方で講演を希望される場合は、日本表面真空学会への入会手続きを行ってください。

4.3 申込方法

講演申込はウェブページからの電子申込のみです。

講演申込と同時に、予稿集原稿を電子投稿で提出いただきます。

講演申込・予稿受付期間 2021年8月2日(月)13:00～8月31日(火)17:00(ウェブ受付)

詳細は、次号以降の会誌の会告ならびにウェブページで随時お知らせいたします。

4.4 発表番号：10月上旬までにE-mailにて申込者に採択結果をご連絡します。

4.5 参加費

参加費は参加登録期間内に振り込んでください。事前登録のご協力をお願い致します。

お支払い完了後のキャンセルによる返金は出来ません。

事前参加登録期間 2021年8月2日(月)13:00～10月29日(月)17:00(ウェブ受付)

会期中参加登録期間 2021年11月3日(木)0:00～11月5日(金)17:00(ウェブ受付)

区分	種別	事前	会期中
一般	日本表面真空学会個人正会員(不課税)	6,000円	6,500円
	日本表面真空学会 法人正会員, 維持会員, 賛助会員の所属会社員(不課税)		
	協賛学協会会員(消費税込)	8,000円	8,500円
	非会員(消費税込)	9,000円	9,500円
学生	日本表面真空学会学生会員(不課税)	3,000円	3,500円
	協賛学協会学生会員(消費税込)	6,000円	6,500円
	非会員(消費税込)	6,000円	6,500円

5. 展示会：オンライン開催を検討中です。

詳細は、次号以降の会誌の会告ならびにウェブページで随時お知らせ致します。

主催：公益社団法人 日本表面真空学会

協賛(予定)：映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 原子衝突学会, 低温工学・超電導学会, 電気学会, 電子情報通信学会, 日本加速器学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本顕微鏡学会, 日本原子力学会, 日本材料学会, 日本質量分析学会, 日本真空工業会, 日本チタン協会, 日本鉄鋼協会, 日本半導体製造装置協会, 日本物理学会, 日本分析化学会, 日本放射光学会, 表面技術協会, 腐食防食学会, プラズマ・核融合学会

各セッションキーワード表

下記の分野に関する講演を募集します。なお、適宜合同セッションを編成することがあります。

分 野	キ ー ワ ー ド
表面科学 (SS1) 物性	電子状態, 電子物性, 光物性, 光電変換, 磁性, 物性理論, 量子効果, コヒーレンス, 電子相関, ナノトライボロジー, 超伝導, 密度波, トポロジカル絶縁体, 計算科学
表面科学 (SS2) 反応	表面化学反応, 吸着/脱離, 拡散, 相転移, 電極表面, 反応性, 反応場, 反応機構, 反応ダイナミクス, 触媒, 光触媒, メソ細孔材料, ナノ反応場, マイクロ反応システム, 電気化学, 計算科学
表面科学 (SS3) 構造	表面再構成, 表面超構造, 原子・分子マニピュレーション, MEMS, リソグラフィ, 表面改質, FIB, ビーム技術, プラズマプロセス, 計算科学
表面分析・応用表面科学・評価技術 (ASS)	電子分光, イオン分光, X線分光, 放射光, 界面分光, ホログラフィー, 時間分解計測, プローブ顕微鏡, 顕微分光, アトムプローブ, 電子顕微鏡, 単一分子分光, 表面回折, オペランド計測, LEEM, PEEM, 陽電子計測, TERS, 非線形分光, 振動分光, マイクロビームアナリシス, 標準化, 表面処理, 実験技術, 電子源, 計算科学
表面工学 (SE)	表面改質, コーティング, 超撥水, 超親水, 溶射, 腐食防食, 焼結, 浸炭, 接合, トライボロジー
真空科学技術 (VST)	真空ポンプ, 真空計測, 真空材料, 流れ解析, ガス放出, 極高真空, 加速器, 真空応用技術, 真空プロセス一般
薄膜 (TF)	薄膜物性, 薄膜構造, 解析技術, 作製技術, 磁性薄膜, 薄膜応用
低次元・ナノ構造・ナノ物質 (LD・NS・NM)	ナノ構造, ナノ物性, ナノ計測, TEM, SPM, CNT, グラフェン, クラスタ
半導体・磁気・電子・光デバイス材料・電子材料プロセス (EMP・MI・MS)	半導体, 有機半導体, 有機電子デバイス, スピントロニクス, 誘電体薄膜, 酸化膜, 薄膜, レーザー, 量子ドット, 量子細線, 量子井戸, 超格子, 界面, ハイブリッド材料, 真空デバイス, 太陽電池, CVDプロセス, エッチングプロセス, 計算科学
プラズマ科学技術 (PST)	プラズマ計測, プラズマ源, プラズマプロセス, スパッタ, イオン技術, 核融合, プラズマ応用
ソフトマター・バイオ (SO・BI)	有機材料, 高分子材料, 生体高分子材料, バイオナノテクノロジー, バイオデバイス, バイオセンサ, DNAデバイス, タンパク質チップ, 一分子生体情報, 分子認識, 生体分子関連, 人工臓器, コロイド, トライボロジー, 計算科学
環境・エネルギー材料 (SU・EN)	二次電池, 太陽電池, 環境触媒, 光触媒, 燃料電池, 環境浄化触媒, バイオマス, エネルギー, 環境負荷低減技術, 宇宙関連技術, 計算科学
そ の 他	

2021 年日本表面真空学会学術講演会における講演奨励賞募集

「2021 年日本表面真空学会学術講演会」が 2021 年 11 月 3 日（水）～ 5 日（金）に、オンラインで開催されます。本会の学術講演会において、表面と真空に関する科学と技術の発展に貢献しうる優秀な一般講演（口頭およびポスター）を発表した若手会員に対して講演奨励賞を授与します。本賞には、受賞対象者の資格に応じて、「講演奨励賞（若手研究者部門）」、「講演奨励賞（新進研究者部門）」および「講演奨励賞（学生部門）」があります。いずれの部門でも、

- 1) 講演の筆頭者であること
- 2) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇したものであること

を満たす必要があります。各部門の資格は以下のとおりです。

【若手研究者部門】

個人正会員であること。発表年の 4 月 1 日時点で満 33 才以上、満 39 才以下であること。

【新進研究者部門】

個人正会員であること。発表年の 4 月 1 日時点で満 32 才以下であること。

【学生部門】

発表年月日において学生として在籍する学生会員、または発表年の途中まで学生として在籍した個人正会員、または、学術講演会委員会において資格ありと認められた者。

※法人正会員に所属する方で個人正会員になられていない方は、講演奨励賞応募にあたっては個人正会員としてご入会頂く必要がありますのでご注意ください。

審査は、講演奨励賞選定委員会が定めた審査委員により、研究・開発のレベル・面白さ、発表や図のわかりやすさなどについて厳正に行います。当日の発表だけではなく、予稿の内容やアピールポイントも審査の対象です。

講演奨励賞受賞者には、次年度総会において表彰状とメダルを授与するとともに、発表題名と発表者を日本表面真空学会ウェブページに掲載します。